

**Перечень оборудования центра коллективного пользования**  
 «Аппаратно-программные средства измерений и контроля параметров  
 сверхширокополосных ВЧ и СВЧ устройств импульсными методами» (ЦКП «Импульс»)

№ п/п	Наименование	Марка	Страна происхождения фирмы-изготовителя	Год выпуска	Количество единиц
1	Аппаратно-программный комплекс для проведения микроволнового анализа на базе зондовой станции Cascade M150	Cascade M150	Соединённые Штаты Америки	2012	1
2	Векторный анализатор цепей N9952A Загрузка	Keysight Technologies	Соединённые Штаты Америки	2015	1
3	Векторный анализатор цепей ZVA40	Rohde&Schwarz	Германия	2012	1
4	Векторный анализатор электрических цепей до 40 ГГц	Rohde&Schwarz	Германия	2015	1
5	Генератор СВЧ сигналов Rohde&Schwarz	Rohde&Schwarz	Германия	2017	1
6	Испытательная климатическая камера (тепло-холод)	ESPEC SU-262	Япония	2012	1
7	Микроскоп INM 100 UV	INM100UV	Германия Vistec (Leica)	2009	1
8	Нелинейный рефлектометр	P4-И-02	Россия ООО "Сибтроника", Tektronix	2012	1
9	Полуавтоматическая установка ультразвуковой микросварки TPT	TPT HB-05	Германия TPT Wire Bonder	2012	1
10	Стенд измерения векторных характеристик цепей в импульсном режиме на базе Обзор 103, Caban 140, S5048, P4-И-01	Caban 140, S5048, P4-И-01	ООО "Сибтроника", "Планар" Россия	2015	1
11	Стенд измерения мощностных характеристик на базе зондовой станции Cascade Microtech Summit 11К и СВЧ тюнеров	Summit 11К	Соединённые Штаты Америки Cascade Microtech	2008	1
12	Технологическая линия фотолитографии	АДА-0,010, БАВнп-01-Ламинар-С	Россия	2008	1

		(9 ед.),			
13	УНУ «Установка плоттерной печати чернилами с широким диапазоном вязкости» (2D-плоттер)	Sonoplot Gix Microplotter	Соединённые Штаты Америки Sonoplot	2013	1
14	Установка допроявления фоторезиста YES-G500	YES-G500	Соединённые Штаты Америки YES	2008	1
15	Установка нанесения фоторезистов	OPTispin SB20	Корейская Народно-Демократическая Республика MIDAS SYSTEM	2008	1
16	Установка отмывки пластин	OPTwet SB30	Германия	2008	1
17	Установка электронно-лучевого и ВЧ магнетронного напыления	Orion-B	Корейская Народно-Демократическая Республика	2008	1
18	Электронный микроскоп Zeiss Supra 55 с функцией электронного литографа	Raith 150 Two	Германия Raith	2009	1